

# Dispositif De Purge De Gaz Inerte En Pfa Haute Pureté Pour L'analyse De Traces De Précurseurs Semi-Conducteurs - Système De Purge Compatible Avec L'azote Et L'argon

Numéro d'article: PL-CP429



## Introduction

Dispositif de purge de gaz inerte en PFA ultra-haute pureté pour la détection et l'analyse de traces de précurseurs semi-conducteurs. Conçu pour la purge à l'azote ou à l'argon, il prévient l'oxydation et la contamination des échantillons dans les flux de travail de laboratoire critiques. Construction durable et résistante aux produits chimiques pour la recherche professionnelle.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Test des précurseurs semi-conducteurs	Purge des précurseurs organométalliques à l'argon pour prévenir l'oxydation avant l'analyse ICP-MS.	Garantit une caractérisation précise des précurseurs ALD/CVD.
Contrôle qualité de fabrication de CI	Purge au gaz haute pureté pour l'analyse de traces métalliques dans les produits chimiques de procédé.	Réduit la limite de détection en éliminant la contamination liée au matériau.
Recherche sur les électrolytes de batterie	Protection des composants de batterie au lithium sensibles à l'humidité pendant l'extraction par solvant et la purge.	Préserve la stabilité de l'électrolyte pour des tests électrochimiques cohérents.
Synthèse de catalyseurs	Gestion des catalyseurs sensibles à l'air lors de la transition entre synthèse et analyse.	Empêche l'empoisonnement du catalyseur par l'oxygène atmosphérique ou l'humidité.
Analyse de traces pétrochimiques	Élimination des fractions volatiles des matrices d'hydrocarbures complexes par déplacement à l'azote.	Excellente résistance aux composés soufrés agressifs et aux solvants.
Préparation de nanomatériaux avancés	Maintenir un environnement inerte pendant la préparation d'échantillons de nanoparticules fonctionnalisées.	Préserve la chimie de surface et empêche l'oxydation de surface non intentionnelle.
Analyse de gaz spéciaux	Servir d'interface haute pureté pour l'échantillonnage et l'analyse des gaz électroniques haute pureté.	Empêche le bruit de fond dû aux fuites atmosphériques ou au dégazage du matériau.

Caractéristique	Détails de la spécification (PL-CP429)
<b>Matériau principal</b>	PFA (Perfluoroalcoxy) ultra-haute pureté
<b>Procédé de fabrication</b>	Usinage CNC de précision / Fabrication sur mesure
<b>Capacité standard</b>	30 ml (tailles personnalisées disponibles sur demande)
<b>Compatibilité gazeuse</b>	Azote (N <sub>2</sub> ), Argon (Ar), Hélium (He) et autres gaz inertes
<b>Résistance chimique</b>	Résistance à tous les solvants courants, acides forts et bases
<b>Plage de température</b>	Entièrement personnalisable en fonction des exigences de température de l'application spécifique
<b>Classification de pression</b>	Conception optimisée pour les pressions de purge de gaz standard (personnalisable)
<b>Ports de connexion</b>	Adaptés pour s'adapter aux lignes de gaz existantes et aux interfaces d'instruments analytiques

Application	Description	Avantage clé
Caractéristique	Détails de la spécification (PL-CP429)	
Protocole de nettoyage	Compatible avec les procédures de lavage à l'acide et de nettoyage haute pureté	